

表面技術協会 「将来めっき技術検討部会」開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、表面技術協会 「将来めっき技術検討部会第31回例会」を公開で下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

記

日時 : 平成30年1月16日(火) 13:00~17:15

場所 : 回路会館 地下会議室

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

テーマ「設備が支えるめっき技術」

13:00~13:50

「硫酸銅めっきにおける設備及び基材がめっき性能に与える影響について」

奥野製薬工業株式会社 小倉 英稔

13:50~14:50

「新方式縦型垂直連続搬送めっき装置の紹介」

上村工業株式会社 内海雅之

----- 14:50~15:05 休憩 -----

15:05~16:15

「樹脂めっきの装置と処理製品・機器更新のデータ管理の方向性」

株式会社 JCU 富田 則之

16:15~17:15

「半導体用電解めっき装置」

荏原製作所 長井瑞樹

参加費 : 部会員、幹事、公的機関(経産省・NEDO) : 無料

表協会員 : 5千円(学生 2千円)

協賛団体会員 : 5千円(学生 2千円)

一般 : 1万円(学生 5千円)

定員 : 100名 (定員になり次第締め切り)

申し込み先・問い合わせ先 :

(一社) 表面技術協会 将来めっき技術検討部会事務局 上野千恵美

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-1 神田レンガビルディング

電話 : 03-3252-3286 FAX : 03-3252-3288

e-mail : ueno912@sfj.or.jp

参加申し込みは、上記あてに、電子メールまたはFAXで、参加者1名につきそれぞれ、

「(1)氏名、(2)所属、(3)会員種別(部会会員、表協会員、協賛団体会員、一般、学生)、
(4)電子メールアドレス、(5)住所」を御記載ください。

以上